

Mikroskope

INM200

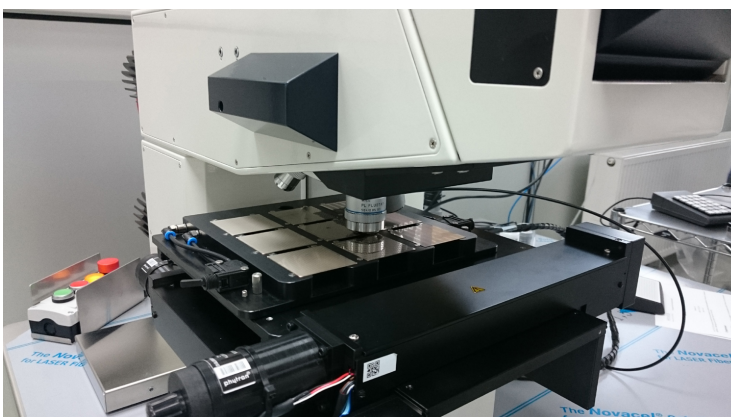


Das softwaresteuerbare Hochleistungsmikroskop:

- Schneller und hochpräziser Laser-Autofokus
- Motorischer 6-fach Objektivrevolver
- Motorisch gesteuerte Blenden
- Auflicht für Hellfeld, Dunkelfeld, Interferenzkontrast und Polarisation
- VIS, Infrarot und sichtbares Durchlicht, optional Polarisation
- Motorischer Z-Hub 30 mm, Schritt-Auflösung von 18 nm

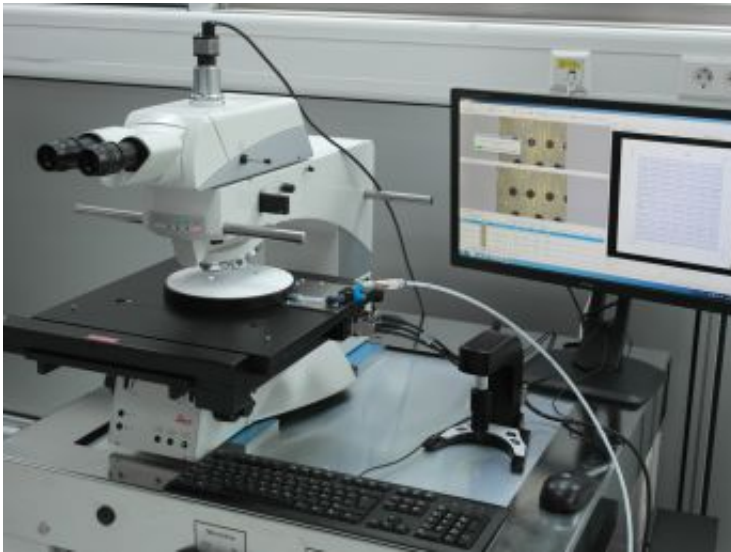
Optionen:

- Multikamera Port für S/W-, Color-, IR-Kameras
- Weißlichtinterferenz
- Konfokalmodul
- Präzise Scanningtische
- Fasergekoppelte Spektrometer



INM200 mit Multi-Substrathalter

DM8000 IS



Leica DM8000 Konfiguration mit Promicon MCS Software zur halbautomatischen Wafer & MEMS Inspektion

Optionen:

- Infrarot Auflicht und Durchlicht, einsetzbar für den Spektralbereich VIS und NIR
- Vorder-/Rückseiten-Ausrichtung (top-bottom alignment) auf Si-Wafer durch Silicium-Inspektion
- MCS Software Suite für Inspektion, Review und ein breites Spektrum an Messaufgaben von Strukturbreiten, Overlay, Schichtdicken, Kantenhöhen und Oberflächenprofilen.
- Scanningtische für ultra schnelles SCANNING ON THE FLY
- Weißlichtinterferometrie

IRUVIS Multispektrales Mikroskop



Mess- und Inspektionsmikroskop mit multispektraler Konfiguration. Das INM200 überzeugt mit höchster optischer Leistungsfähigkeit, schneller, einfacher Bedienung und Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten über Stunden.

Leica HC Optik. Höchste optische Leistungsfähigkeit bei der Sichtbarmachung kleinster Strukturen.

- Objektivvergrößerungen sind von 1.6x - 250x möglich
- Konzentration auf das Wesentliche - die Inspektionsaufgabe - und Zugriff auf viele Kontrastverfahren (HF, DF, ICR, FL und Konfokalkontrast)
- Optimierte automatische Einstellung der Aperturblende
- Optimale Vermeidung von Kontamination (Reinraumklasse 1)
- Vorbildliche Ergonomie und höchster Komfort in der Bedienung

Kundenspezifische Mikroskopsysteme

Systeme nach Kundenwunsch:

Mit unseren Engineering- und eigenen Fertigungsmöglichkeiten realisieren wir für Sie anspruchsvolle Systeme für hochauflösende Messung und Inspektion. Als Basismikroskop dient z.B. das INM200 mit seinen Top-Möglichkeiten in Punkto Automatisierung und Hochauflösung.

- 6" und 8" Scanningtische für den präzisen und automatischen Programmablauf
- Messtaster für hochgenaue, berührungslose Z-Messung
- Weißlicht Konfokal-Modul für dünne optische Schnitte
- Weißlichtinterferometrie (WLI)
- Software für Inspektion & Messung
- Software für applikationsspezifische Aufgaben

Anfrage